

MEMS エンジニア育成のための集中コース in 仙台

- 日時 : 集中講義 8/3 (水) ~8/5 (金)、見学会 8/2 (火) 見学先は以下を予定
東北大「試作コインランドリ」 <http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/index.html>
東北大「マイクロナノセンター(MNC)」 <http://vbl.mech.tohoku.ac.jp/index.html>
「仙台 MEMS ショールーム」 <http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/showroom/index.html>
「(株)MEMS コア」 <http://www.mems-core.com/> 他
- 場所 : 東北大学 カタールホール <http://qsc.eng.tohoku.ac.jp/jp/map.html>
(仙台駅から地下鉄東西線で青葉山駅下車)
カタールホールの青葉山工学部までのアクセス <http://www.eng.tohoku.ac.jp/map/access.html>
- 主催 : 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター (μSIC) <http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/>
MEMS パークコンソーシアム (MEMSPC) <http://www.memspc.jp/>
- 共催 : 東北大学 マイクロ・ナノマシニング研究教育センター (MNC)
http://www.mnc.mech.tohoku.ac.jp/index_jp.html
ナノテク支援センター (CINTS) <http://cints-tohoku.jp/>
- 参加 : 無料 (交流会参加費は有料) 冊子と DVD などを無料配布、申込不要 当日直接参加可、
交流会 : ¥4,000/名 (MEMSPC 会員 : 一口につき 1 名無料)
展示会 : Mini 展示会 (15 小間) を併設致します。(詳細は別紙参照)
問合先 : 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター 蛸島武尚
Tel : 022-795-6256、Fax : 022-795-6259、E-mail : tako@mems.mech.tohoku.ac.jp
詳細 (前回) : <http://www.memspc.jp/openseminar/opense61.html>

【プログラム】

【8月3日(水)】(基礎)

- 10:00-12:00 マイクロマシニング 1 (概論、フォトファブリケーション、エッチング) [江刺]
12:00-13:30 昼食
13:30-16:05 マイクロマシニング 2 (堆積、接合、複合プロセス、パッケージング他) [江刺]
16:05-16:15 休憩
16:15-16:45 マイクロアクチュエータ [吉田]
16:45-17:15 MEMS と LSI のシステム集積化 [室山]
17:15-17:45 ナノ構造の作製、評価、応用 [戸田]
17:45-18:15 エネルギーハーベスタ [桑野]

【8月4日(木)】(バイオ・医療、産業化)

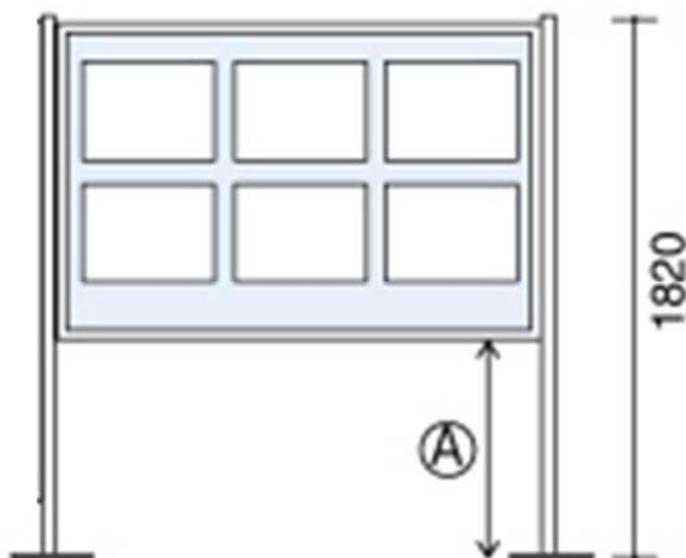
- 9:30-10:15 医療・ヘルスケア(健康管理) 応用 [芳賀]
10:15-11:00 マイクロ/ナノ技術とバイオデバイス [西澤]
11:00-12:00 電気化学バイオイメージング (含東北大-東芝 COI の紹介) [未永]
12:00-13:30 昼食
13:30-14:30 IoT 時代に必要な MEMS 開発課題と人材育成 [松本佳宣 (慶応大)]
14:30-15:25 3D Integration and Packaging [J.Froemel (フラウンホーファー・プロジェクトセンター)]
15:25-15:35 休憩
15:35-16:25 メムス・コアの紹介 -MEMS の受託開発- [本間]
16:25-17:15 ACI (Advantest Component, Inc.) における MEMS ファンドリーサービス
[増井宏二 (アドバンテストコンポーネント)]
17:15-18:05 試作コインランドリと MEMS パークコンソーシアムの紹介 [戸津]
18:15-20:00 交流会

【8月5日(木)】(応用)

- 9:30-10:40 自動車・家電 (圧力、加速度・ジャイロ、地磁気、マイク他) [田中]
10:40-11:30 情報・通信応用 (BAW, RFMEMS スイッチ、周波数源他) [田中、原]
11:30-12:00 弾性表面波デバイス [門田]
12:00-13:30 昼食
13:30-14:25 サブ波長光構造 [金森]
14:25-15:25 製造・検査関連 (電子線制御、分析、微量流体制御他) [小野]
15:25-15:35 休憩
15:35-16:05 MEMS を使った非冷却赤外線熱イメージングデバイス [塚本]
16:05-17:15 最近の MEMS [田中]

Mini 展示会の概要及び出展要領

- 日 時： 平成 26 年 8 月 3 日（火） 10:00~18:15
平成 26 年 8 月 4 日（水） 9:30~20:00（18:00~20:00 は交流会と併催）
平成 26 年 8 月 5 日（木） 9:30~17:15
- 場 所： MEMS 集中コースの会場前のホワイエ（添付のレイアウト図を参照下さい）
- 出展料： 無料
- 出展形式： ポスター、サンプルの展示及び配布物（カタログ、パンフレット）
PC 等電源を必要とする場合は、テーブルタップをご用意下さい。
（レイアウト図に電源の位置を示しました。電源まで通り小間には電源ドラム等で電源を用意致します）
- 小間形式： 1,800×600mm のテーブル 及び ポスターパネル（1,800×1,200mm 横置き 下図参照）
（ポスターをパネルに固定する際は画鋲をご使用下さい）
- 小間数： 15 小間
（出展希望が多数の場合は先着順とさせていただきます）
- 設営・撤収： 設営は 8/3（火）9:00~9:30 でお願い致します。
撤収は 8/7（木）17:15~18:00 でお願い致します。
上記以外は講義中となりますので、休憩時間、昼食時間に設営・撤収をお願い致します。
- 問合せ先： 蛸島 武尚
マイクロシステム融合研究開発センター
TEL：022-795-6256 FAX：022-795-6259
E-mail: tako@mems.mech.tohoku.ac.jp



使用するポスターパネル

カタールホール及びホワイエのレイアウト

